

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 总裁 山崎秀和
公司地址 京都府向日市森本町东之口 1-1
Nidec Park C 栋

尼得科精密检测科技将亮相“SEMICON Japan 2025”

尼得科精密检测科技株式会社将亮相 2025 年 12 月 17 日(周三)~12 月 19 日(周五)于东京国际会展中心举办的“SEMICON Japan 2025”(2025 日本东京半导体展览会)。



在本届展览会上，尼得科精密检测科技将以“**One Stop Solution (一站式解决方案)**”为主题，展出面向 AI 服务器、功率半导体的前沿解决方案。展示内容包括：专为面板级封装和基板产品优化的、融入了 AI 技术的 AVI、2D/3D 光学检测设备，以及适用于 IGBT/WBG 器件等领域的晶圆 (KGD) /模块的电特性测试设备。同时还将根据市场趋势提供前沿的检测技术方案 (例如：可满足含热管理在内的新型检测需求的探针卡等)。

〈参展概要〉

- 展期：2025 年 12 月 17 日(周三)~12 月 19 日(周五)
- 地点：东京国际会展中心 东展厅
- 展位：4Hall E4922
- 官网：<https://www.semiconjapan.org/en>

〈参展亮点〉

- 光学检测设备“RWi-300MK3”：融入了 AI 技术的 2D+3D 检测
- 功率半导体检测设备“NATS Series”：可支持 IGBT/WBG 设备
- 可支持高电压的加压结构探针卡：应用放电对策
- 设备温度测量探针：应用热电偶技术
- 2D-MEMS 探针卡：适用 2D-MEMS 技术，支持 CMOS 图像传感器
- 垂直型窄间距对应探针卡：采用高精度电镀技术，支持 55 μm 窄间距
- 探针“NS Probe”：利用 MEMS 工艺实现微细化与特殊形状
- 自动搬运装置“EFEM”：支持工厂自动化
- 通电检测装置“GATS-8360A”：面向 AI・LEO 卫星基板
- 通电检测装置“GATS-7885”：面向 PLP/Interposer